

反射膜厚仪 SR-C

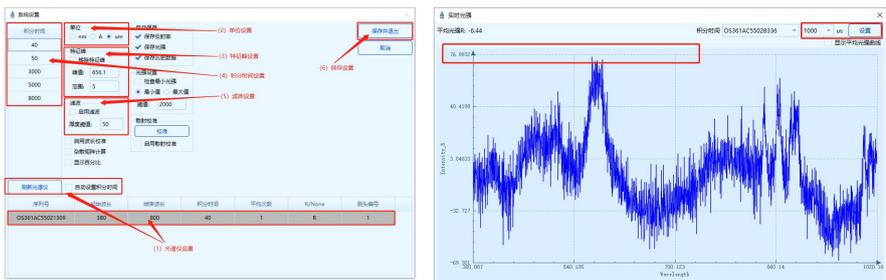
技术规格书



本设备利用反射干涉的原理进行无损测量，测量吸收或者透明衬底上薄膜的厚度以及折射率，同时提供样品反射率，测量精度达到埃级的分辨率，测量迅速，操作简单，界面友好，测量时间不到 1 秒。可应用于光阻、半导体材料、高分子材料等薄膜层的厚度测量，在半导体、太阳能、液晶面板和光学行业以及科研院所和高校都得到了广泛的应用。

技术参数：

设备名称型号	反射膜厚仪 SR-C
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 电源：AC 220V 50HZ • 功率：60W • 基本功能：获取薄膜厚度值以及 R、N/K 等光谱 • 光谱分析范围：380nm-1000nm • 测量光斑大小：标准 1.5mm，最小 0.5mm • 膜厚重复性测量精度：0.02nm (100nm 硅基 SiO₂ 样件，500 次重复测量) • 膜厚绝对精度：0.2%或 2nm 之间较大者 • 膜厚测量范围：15nm-70 μm • 测量 n 和 k 值厚度要求：100nm 以上 • 单点测量时间：≤ 1s • 光源：高性能进口标准卤素灯光源 • 基板尺寸：最大支持样件尺寸到 200*200mm(可升级定制不同尺寸样品台)
测控与分析软件	<ul style="list-style-type: none"> • 分析软件：多达数百种的光学材料常数数据库，并支持用户自定义光学材料库；提供多层各向同性光学薄膜建模仿真与分析功能 • 光谱测量能力：反射率光谱测量 • 数据分析能力：膜厚分析能力，光学常数(折射率和消光系数) • 支持常用光学常数模型以及常用振子模型(柯西模型、洛伦兹模型、高斯模型等)； • 支持用户自定义，可授权离线分析软件模拟实际测量，支持 windows 10

	<p>操作系统</p> 
涂装与表面处理	<ul style="list-style-type: none"> • 涂装颜色：以黑白灰色为主 • 表面处理：镀化学镍、阳极处理、 烤漆等
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 标准 SiO₂/Si 标样 • K9 玻璃标样 • 标准安装工具一套
环境要求	<ul style="list-style-type: none"> • 承载台：尺寸>1.0m (长) ×0.7m (宽)， 承载能力大于 20Kg • 使用温度范围： 20~26 °C • 相对湿度： 35%~60% RH • 空气压力范围： 750~1014 mbar • 洁净度： Class 1000
质保与售后服务	<ul style="list-style-type: none"> • 整机硬件质保期为 12 个月。在质保期内出现各类故障供方及时免费维修， 对非人为造成的各类零件损坏， 及时免费更换 • 测控与分析软件：终身免费升级， 数据分析软件提供不限量拷贝 • 为用户提供全面充分仪器操作与数据分析培训 • 提供 12 个月免费数据建模与分析技术支持， 免费期为用户提供样件材料光学 常数标定与模型库升级服务